

1128.クロスセクションポリッシャ



装置設備名称	クロスセクションポリッシャ
メーカー	日本分光(JEOL)
商品名・型式	IB-09020CP
性能・仕様	<ul style="list-style-type: none">○試料面上にセットされた遮蔽板にイオンビームを垂直に照射し、イオン照射を受けエッチングされる領域と、遮蔽板で遮蔽される領域の境界に沿って、試料の断面を形成させることが可能○また、内部カメラによって試料加工状態を観察することが可能
設備概要・用途	高分子膜の断面観察を行う際に、膜断面の形成に使用
対象試料	固体試料
その他・注意事項	